

別表第1(中高生等に対する教育実習等)(第7条関係)

NO	機器名	測定方法	利用料
1-1	イメージングプレート単結晶自動X線構造解析装置 (試料吹付低温装置付属)	室温測定	17,000円/日
		低温測定	20,000円/日
1-2	透過型電子顕微鏡(ナノ環境物質表面複合分析システム)	通常	20,000円/日
1-3	タンデム型質量分析装置 (超微量環境汚染物質分析・構造解析システム)	MS測定	20,000円/日
		MS/MS測定	25,000円/日
1-4	ICP発光分析装置	通常	20,000円/日
1-5	光電子ナノ表面分析装置	通常	20,000円/日
1-6	走査型電子顕微鏡	通常	25,000円/日

※ 上記以外の中高生等に対する教育実習等の料金は、本部長が利用者と協議の上決定するものとする。

別表第2(依頼分析)(第7条関係)

NO	機器名	測定方法	機器利用料	依頼分析料
2-1	タンデム型質量分析装置 (超微量環境汚染物質分析・構造解析システム)	EIまたはFAB測定	5,000円/時間	70,000円/試料
		ESIまたはMS/MS	10,000円/時間	70,000円/試料
2-2	高分解能溶液核磁気共鳴測定装置 (溶液用NMR)	1時間以内の測定 1H・13C	3,000円/時間 (講習が必要な場合は別途10,000円)	3,000円/試料
		4時間以内の測定 1H・13C		6,000円/試料
		12時間以内の特殊測定 2次元など		12,000円/試料
		12時間以上の測定 その他の特殊測定		18,000円/試料
2-3	高分解能固体・溶液核磁気共鳴測定装置 (固体・溶液兼用 NMR)	1時間以内の測定 1H・13C	3,600円/時間 (講習が必要な場合は別途10,000円) (固体は要相談)	3,000円/試料
		4時間以内の測定 1H・13C		6,000円/試料
		12時間以内の特殊測定 2次元など		12,000円/試料
		12時間以上の測定 その他の特殊測定		18,000円/試料
2-4	MSE表面強度評価装置	一般条件での測定及び解析	なし	50,000円/試料
2-5	Boonton 72B Capacitance meter	DLTS またはICTS測定	なし	216,000円/試料 電極作製費(Ni蒸着) 108,000円
2-6	界面顕微光応答測定装置		なし	43,200円/測定 電極作製費(Ni蒸着) 108,000円
2-7	ソースユニット2657A	3kVまでのI-V測定	なし	16,200円/時間
2-8	iHR32 CCDカメラ付分光器 IK3151R-E ヘリウムカドミウムレーザー		なし	108,000円/試料
2-9	テラヘルツ時間領域分光装置	透過型または反射型測定	なし	5,000円/試料 試料形態などにより要相談

※ 上記以外依頼分析料は、本部長が利用者と協議の上決定するものとする。

※ 各機器の使用時間は1ヶ月を単位として集計し、1時間未満の利用は切り上げて利用料を計算するものとする。

別表第3(機器・施設利用料)(第7条関係)

NO	機器名	測定方法	機器利用料	機器操作指導料 (2回目までは必須3回目以降は指導者の判断による)	施設No.	施設利用料
3-1	走査型電子顕微鏡(SEM)	試料作製含まず	10,000円/時間	6,000円/時間		
3-2	イメージングプレート単結晶自動X線構造解析装置 (試料吹付低温装置付属)		20,000円/試料	10,000円/試料		
3-3	電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)	試料作製含まず	20,000円/時間	7,000円/時間		
3-4	高感度マイクロファイバー引張試験機	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-5	パルスYAGレーザー装置	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-6	透過型電子顕微鏡(TEM) (ナノ環境物質表面複合分析システム)	試料作製含まず	30,000円/時間	10,000円/時間		
3-7	同時5軸制御小型マシニングセンタ	試料作製含まず	10,000円/時間	8,000円/時間		
3-8	3次元デジタイザーシステム (Dimension/3次元プリンタ)		モデリング材料 88,000円×使用率 サポート材料 88,000円×使用率	10,000円/回		
3-9	3次元デジタイザーシステム (ATOS/3次元スキャナ)		1,000円/時間	20,000円/回		
3-10	3次元デジタイザーシステム (XOR/リバーエンジニアリングソフトウェア)	起動 dongle の 貸出	1,000円/時間	20,000円/回		
* 3-11	断面試料作成装置(クロスセクションポリッシャー)	試料作製含まず	10,000円/時間	10,000円/回		
* 3-12	ICP発光分析装置	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
* 3-13	光電子ナノ表面分析装置(AES)	試料作製含まず	30,000円/時間	10,000円/時間	4-205	300
* 3-14	走査プローブ顕微鏡	カンチレバー他の 消耗品は実費	10,000円/時間	7,000円/時間 (講習が必要な場合は別途10,000)		
* 3-15	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR) (顕微領域赤外分光システム)	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間	4-303	400
* 3-16	ナノめっき皮膜構造解析システム(XRD)	試料作製含まず	20,000円/時間	8,000円/時間		
* 3-17	極微小特殊成分解析装置(FE-SEM)	試料作製含まず	30,000円/時間	9,000円/時間	4-305	400
3-18	共焦点レーザー走査型顕微鏡	試料作製含まず	10,000円/時間	6,000円/時間		
3-19	試料水平型多目的X線解析装置 (繊維界面構造評価システム)	試料作製含まず	10,000円/時間	8,000円/時間		
3-20	高分解能薄膜構造解析用X線回折装置	試料作製含まず	10,000円/時間	8,000円/時間		
3-21	角度分解絶対反射率測定装置	試料作製含まず	10,000円/時間	6,000円/時間		
3-22	ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-23	ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MSD)	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-24	ガスクロマトグラフ(GC)	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-25	冷陰極電界放射型走査型電子顕微鏡	試料作製含まず	20,000円/時間	7,000円/時間		
3-26	波長分散型蛍光X線分析装置(WDX)	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-27	高機能比表面積 細孔分布測定装置	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-28	粘弾性測定装置	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-29	水銀ポロシメータオートポア	試料作製含まず	5,000円/時間 300円/水銀1cc	20,000円/回		
3-30	複合材界面特性評価装置(マイクロドロップレット)	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
3-31	電子スピン共鳴装置(ESR)	試料作製含まず	10,000円/時間	8,000円/時間		
3-32	卓上走査電子顕微鏡	試料作製含まず	20,000円/時間	7,000円/時間		
3-33	デジタルビッカース硬度計	試料作製含まず	3,000円/時間	7,000円/時間		
3-34	ゼータ電位測定システム	試料作製含まず	10,000円/時間	7,000円/時間		
* 3-35	マイクロマニピュレータ	試料作製含まず	10,000円/時間	5,000円/回	4-305	400
3-36	元素マッピング機能付走査型電子顕微鏡	試料作製含まず	20,000円/時間	7,000円/時間		
* 3-37	冷却加熱ステージ	試料作製含まず	10,000円/時間	5,000円/回	4-303	400
* 3-38	超絶縁抵抗計	試料作製含まず	10,000円/時間	5,000円/回	4-301	400
* 3-39	クライオCP	試料作製含まず	20,000円/時間	15,000円/回	4-205	300

※ 上記以外の機器操作指導を含む機器利用料は、本部長が利用者と協議の上決定するものとする。

※ 各機器の使用時間は1ヶ月を単位として集計し、1時間未満の利用は切り上げて利用料を計算するものとする。

※ 機器操作を単独で行ってよい者は、指導・最終確認を受け、かつ使用許可を受けた者のみとする。なお、最終確認は指導料付料金を請求する。

※ 3回目以降の機器利用において、引き続き指導が必要と当方が判断した場合は、指導料付料金を請求する。

※ 同種機器の操作経験がある等、機器操作において特に優れていると当方が判断した場合は、機器操作指導の回数を減らすことがある。

※ 機器利用料及び機器操作指導料は、学内者が利用する場合は表に定める料金の10%、産学官連携本部協力会会員及び教育・公共機関等が利用する場合は50%とする。

※ *の機器を使用した場合は、施設利用料を別途請求する。施設利用料は利用者が学内外や産学官連携本部協力会への加入の有無に係らず別表に記載どおりの一律料金とする。

別表第4(機器・施設利用料)(要項第7条関係)

No.	機器名	機器 利用料 (円/時間)	機器操作指導料 (円/時間) (2回目までは必須 3回目以降は指導 者の判断による)	施設No.	施設名	施設利用料 (円/時間)
4-1	ナノ結晶方位可視化装置 ※単体での使用不可	3,000	10,000	4-205	II-205 共同研究実験室	300
4-2	昇温脱離ガス質量分析装置(TPD-MS)	2,000	7,000	4-301	II-301 動的微細構造解析室	400
4-3	雰囲気制御高温XRD	2,000	7,000			
4-4	粉体性能評価装置(FT-4)	2,000	7,000			
4-5	三次元ナノ組織可視化装置(X線CT)	5,000	7,000	4-303	II-303 先端材料組織解析室	400
4-6	顕微ラマン装置	2,000	7,000			
4-7	イオンビーム加工・表面分析装置(FIB)	5,000	10,000	4-305	II-305 ナノ表面精密加工室	400
4-8	MOCVD装置	4,000	要相談	4-401	II-401 薄膜作製室(クリーンルーム) * 15人以上利用の場合パック割有	1,000
4-9	クリーンドラフト	1,800	要相談			
4-10	超純水製造装置	1,100	要相談			
4-11	超短パルスレーザ発振機	2,400	要相談	4-402	II-402 レーザー精密加工室(クリーンルーム)	800
4-12	投影露光装置	1,800	要相談	4-501	II-501 めっき室(クリーンルーム)	1,000
4-13	現像装置	1,600	要相談			
4-14	スプレーコーター	1,800	要相談			
4-15	めっき装置	2,200	要相談			
4-16	クリーンドラフト	1,800	要相談			
4-17	超純水製造装置	1,100	要相談			
4-18	蛍光X線装置(膜厚計)	1,600	要相談			
4-19	燃料電池自動評価装置	1,600	要相談	4-502	II-502 燃料電池評価室	300
4-20	燃料電池性能試験装置	1,100	要相談			
4-21	CMP装置	1,600	要相談	4-506	II-506 めっき膜評価室	300
4-22	LIB試作設備	1,600	要相談	4-601	II-601 リチウム電池試作室	300
4-23	LIB電極板作製機	2,100	要相談			
4-24	乾燥空気製造送風装置	7,500	要相談			
4-25	乾燥保管庫	1,400	要相談			
4-26	充放電装置	1,700	要相談	4-602	II-602 充放電試験室	300
4-27	電池評価用恒温槽	1,800	要相談			
4-28	グローブボックス	1,700	要相談	4-605	II-605 フッ素利用加工室	400
4-29	隔離安全性試験設備	3,200	要相談	4-606	II-606 リチウム電池安全性評価室	700
4-30	充放電装置	1,700	要相談			
4-31	電池評価用恒温槽	1,800	要相談			
				4-302	II-302 セキュリティ管理・データ解析室	500
				4-504	II-504 燃料電池試作室	300
				4-604	II-604 微粉末特性評価室	300

※ 各施設・機器使用時間は1ヶ月を単位として集計し、1時間未満の利用は切り上げて利用料を計算するものとする。

※ 機器操作を単独で行ってよい者は、指導・最終確認を受け、かつ使用許可を受けた者のみとする。なお、最終確認は指導料付料金を請求する。

※ 3回目以降の機器利用において引き続き指導が必要と当方が判断した場合は、指導料付料金を請求する。

※ 4-8~31の機器使用については、本部長が利用者と協議の上判断するものとする。

※ 4-205~606は施設のみ利用の場合とする。

※ 機器利用料及び機器操作指導料(料金が要相談の機器は除く)は、学内者が利用する場合は表に定める料金の10%、産学官連携本部協力会会員及び教育・公共機関等が利用する場合は50%とする。施設利用料は利用者が学内外や産学官連携本部協力会への加入の有無に係らず別表に記載どおりの一律料金とする。

* II-401 薄膜作製室(クリーンルーム)は一研究室で15人以上利用の場合、施設利用料パック割(年間85万円)を利用できる。